

# 全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2022]14 号

---

## 关于召开《硅片表面光泽度的测试方法》等 5 项半导体材料标准 网络工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会及中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及 2022 年标委会工作安排，现定于 2022 年 6 月 17 日召开半导体材料标准网络工作会议。现将有关事宜通知如下：

### 一、会议内容和资料

会议将对《硅片表面光泽度的测试方法》等 5 项半导体材料标准进行预审和讨论，具体项目见附件。请各标准项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议。各标准负责起草单位务必于 6 月 15 日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 6 月 16 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

### 二、会议时间

2022 年 6 月 17 日上午 9:00 开始。

### 三、会议参加方式

参会人员可在“腾讯会议”软件界面，点击“加入会议”，输入会议 ID 及“个人姓名-单位”，点击“加入”，参加会议。

会议 ID 见附件。

#### 四、联系方式

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

附件：会议日程安排



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件：

会议日程安排

| 序号 | 计划文号及编号                            | 项目名称                 | 牵头单位          | 备注 | 会议 ID       |
|----|------------------------------------|----------------------|---------------|----|-------------|
| 1  | 国标委发[2020]53 号<br>20204891-T-469   | 硅片表面光泽度的测试方法         | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 预审 | 450-883-812 |
| 2  | 国标委发[2020]48 号<br>20203728-T-469   | 碳化硅外延片表面缺陷的测试 显微可见光法 | 芜湖启迪半导体有限公司   | 预审 |             |
| 3  | 国标委发[2020]53 号<br>20204893-T-469   | 碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法    | 芜湖启迪半导体有限公司   | 预审 |             |
| 4  | 国标委发[2021]12 号<br>20210892-T-469   | 硅片流动图形缺陷的检测 腐蚀法      | 徐州鑫晶半导体科技有限公司 | 预审 |             |
| 5  | 中色协科字[2021]88 号<br>2021-020-T/CNIA | 硅片切割废料回收硅            | 中国科学院过程工程研究所  | 讨论 |             |